

CTA報告144: CTA 小口径望遠鏡用焦点面カメラの統合試験

中村 裕樹、奥村 曉、片桐 秀明^A、佐々井 義矩、Anatolii Zenin、Justus Zorn^B、 田島 宏康、Jim Hinton^B、Richard White^B、三浦 智佳^A、他 CTA Consortium

名大ISEE、茨城大理^A、マックス・プランク核物理^B 日本物理学会、信州大学、2018/09/16



Cherenkov Telescope Array (CTA)



大口径望遠鏡(LST) 直径:23 m ェネルギー:20 GeV - 3 TeV 台数:4(北) + 4(南) 中口径望遠鏡(MST) _{直径}:12 m or 9.6 m エネルギー:80 GeV - 50 TeV 台数:15 (北) + 25 (南) 小口径望遠鏡(SST) 直径:~ 4 m エネルギー:1 - 300 TeV 台数:70(南)



小口径望遠鏡



- »3種類の望遠鏡が提案され、それぞれの試作望遠鏡でチェレンコフ光の観測を成功させた
- » 小口径望遠鏡デザインの最終決定に向けて進めている



半導体光電子増倍素子 (SiPM)

- » MAPMT を用いたカメラでのチェレンコフ光の観測を成功させた(J. Zorn et al. 2018)
- » カメラのアップグレードに向けて光検出器を半導体光電子増倍素子(SiPM)に置き換えた
 - ≫ 高い光検出効率:40% 以上
 - » 低い動作電圧:~50 V
 - » 夜光の多い状況でも観測可能
 - » オプティカルクロストークの発生
 - » 単一光電子を増幅し、複数光電子として検出してしまう現象
 - ≫ トリガー閾値を下げられない
 - ≫ 電荷分解能を悪化させる
 - » ゲインの温度依存性
 - » ダイナミックレンジ、トリガー閾値を変化させる
 - ≫ 温度をモニターし、補正することが必要







焦点面カメラの統合試験

≫ SiPM に置き換えた焦点面カメラを組み上げ統合試験を進めている

» ゲインの調整

- ≫ 波高積分値分布の作成と SiPM の特性評価
- ≫ 波高積分値と検出光電子数の関係の決定
- ≫ 電荷分解能
- ≫ トリガー性能
- ≫ 温度依存性
- » モニタリング
 - ≫ 温度
 - SiPM
 - ・ カメラモジュール
 - ・ バックプレーンボード
 - » トリガーレート

» 望遠鏡に搭載しての試験観測を予定している





焦点面カメラの統合試験:ダイナミックレンジの調整



- » ダイナミックレンジを揃えるために各画素のゲイン を一致させた
- ≫ 50 p.e. 相当の光を照射し 1 p.e. の波高値を 4 mV に設定した (50 p.e. = 200 mV)
 - ~ 500 p.e. まで飽和せず測定可能
 > ノイズ ~1.3 mV より十分大きい
- »~5%のばらつきで揃えられる(0.2 mV / 1 p.e.)
- » 1 p.e. でのばらつきは 0.2 mV で全ての画素でノイズより 十分大きく 1 p.e. を検出できる







焦点面カメラの統合試験:ゲイン測定



- ≫ チェレンコフ光は数十 ns 程度の幅を持つため、波高の積分値から 検出光電子数を決定する
- » 波高積分値の分布に 1 p.e. ごとのピークが見えている
- » ゲインに比例する 1光電子の波高積分値から推定した
- » 1 p.e. の分解能は 60% 以下(4 mV / p.e.)
 - » 1 p.e. の分解能への要求は 200%以下(ポアソン統計のばらつきを含む)
 - » オプティカルクロストークレート~55%以下で要求を満たす



焦点面カメラの統合試験:オプティカルクロストークレート



- ≫ 検出光電子数を正しく推定するためにはオプティカルクロストークによる検出光電子数の増加に対する補正が必要
- » 0 p.e. の事象数から予測されるポアソン分布とのずれから決定した
- ≫ 全画素の発生確率を測定できた ← 検出光電子数の補正ができる
- ≫ 最新の SiPM では 10% 以下に抑えられる(超過電圧 ~3 V)





焦点面カメラの温度特性



- » SiPM の降伏電圧は温度依存性を持つ
 - ≫ 温度によってゲイン、ダークカウント、光検出効率が変化する
 - » 温度の変化に応じて印加電圧の調整が必要である
- » 焦点面カメラは 400–500 W の熱が発生するため、水冷でカメラを冷却している
- » 室温での測定ではSiPM の温度を最大 1 °C 程度の変化で制御可能(温度変化 ~5 °C)





ゲインの温度依存性の測定



- ≫ 冷却水の温度を変化させ意図的にカメラの温度を 変化させることでゲインの温度依存性を測定した
- » 全画素の印加電圧に対するゲインを測定した
- ≫ 観測中のトリガー閾値を安定にするために印加電圧 を調整する
 - ≫ 印加電圧は4画素ごとに設定するため、
 4 画素の平均を代表値とした
 - ≫ フィット直線からのずれは 3% 程度であり 1 p.e. の 波高値に対して十分小さい
 - » 傾きの変化は ASIC の温度依存性が含まれている

≫ SiPM の温度から最適な印加電圧を計算する







- ※ 冷却水を用いて SiPM の温度を変化させてゲインの安定
 性を検証した
 - » SiPM の温度から印加電圧を決定した
 - ≫ 実際の観測時はカメラの温度が 15-25 °C で使用する ことを想定している
- » ゲインの平均値の変化
 - ≫ 印加電圧補正時:~8% (補正なし:~20%)
 - » 閾値の設定に対して十分小さな変化







温度補償時の波高値の確認



- » 50 p.e. 相当照射時の波高値を確認した
- » 簡単のため波高積分値で温度依存性を測定したが、波高値が揃っていなかった
 - » トリガーを安定にするという観点から波高値を揃えないといけない
 - » ASIC の温度依存性が記録電圧値によって異なる
- » 波高値の分布からゲインを測定し補正値を決定する
- » ASIC 単体で温度依存性を測定する
- ≫ 印加電圧は SiPM の超過電圧の調整のみ行う



まとめ



» SiPM を光検出器に置き換えた焦点面カメラの統合試験を進めている

- ≫ 50 p.e. 相当照射時の波高値を用いてゲインを揃えた
 - » ~5%のばらつきで調整できる ← 全画素でノイズより十分大きく 1 p.e.を識別できる
 - » 光量の非一様性を考慮する
- » 波高積分値分布を作成し SiPM の特性を評価した
- ≫ 温度特性
 - »印加電圧の調整によってゲインの変化を8%に抑えることができた
 - ≫ 波高値の分布から温度依存性を測定する
 - ≫ ASIC 単体での温度依存性を測定し補正する
 - » SiPM の降伏電圧の変化のみ印加電圧を補正する

≫ 望遠鏡に搭載しての試験観測を予定している

- » ガンマ線由来のチェレンコフ光を観測する
- » µ粒子から生じるチェレンコフ光を用いたエネルギー較正を実施する
- ≫ 複数の夜光条件で観測し、エネルギー分解能・トリガーへの影響を調査する